

## 装置開発室

渡 辺 三千雄（助教授）

A-1) 専門領域：装置開発

A-2) 研究課題：

- a) 超高真空技術
- b) セラミックスの精密加工技術

A-3) 研究活動の概略と主な成果

- a) 試作した超高真空摩擦試験機により約20種類の表面処理膜について超高真空中における潤滑性能を評価した。また焼付の発生する過程を追跡調査した。
- b) 旧型機を改造し装置開発室でガラスやセラミックスの精密加工が出来るようにした。

C) 研究活動の課題と展望

A-2)で述べた項目を逐次推進し，装置開発室の技術向上を図る。